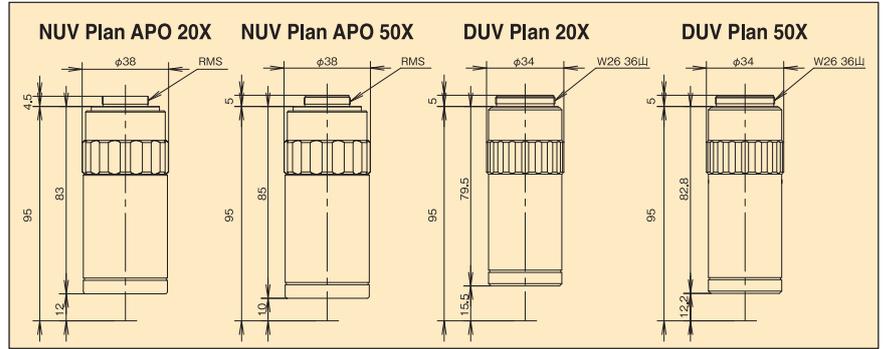


# 近紫外対物レンズ

## NUV/DUV Plan APO20X・50X

明視野観察用の長作動距離対物レンズです。可視域と近紫外 (355/266nm) で使用する波長において、ピントが合うように補正されている対物レンズです。近紫外域の分光透過率を高く設計しており、顕微鏡に取付けてYAGレーザー(355/266nm)を併用することで、半導体回路やLCDのリペアなどの薄膜加工に最適です。



### 仕様

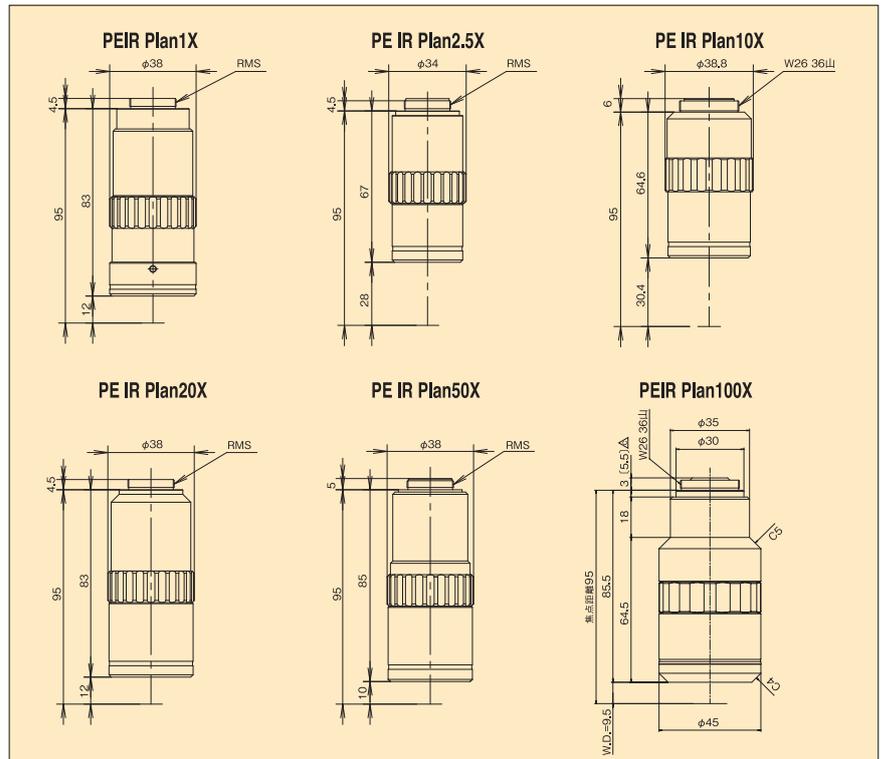
型式	NUV Plan APO 20X	NUV Plan APO50X	DUV Plan 20X	DUV Plan 50X
倍率	20X	50X	20X	50X
作動距離	12mm	10mm	15mm	12mm
焦点距離(f)	10mm	4mm	10mm	4mm
N.A.	0.5	0.5	0.36	0.4
分解能	0.6μm	0.6μm	0.93μm	0.84μm
焦点深度(±D.F)	1.1μm	1.1μm	2.1μm	1.7μm
波長	345nm-1064nm		266-532nm	
最大入射パワー	0.1J/cm2@532nm パルス幅10nsec 0.047J/cm2@355nm パルス幅10nsec	0.1J/cm2@532nm パルス幅10nsec 0.028J/cm2@355nm パルス幅10nsec	—	—
ガラス補正	-/1.0mm(LCD)	-/1.0mm(LCD)	—	—
重量	435g	510g	360g	320g

\* 分解能及び対物レンズ単体での焦点深度は、基本波長 (λ=0.55μm) をもとに算出した値になります。分解能=0.61X0.55/N.A 焦点深度±D (μm)=λ / [2 (N.A.)<sup>2</sup>]

# フォトエミッション用 近赤外対物レンズ

## PE IR Plan対物シリーズ

近赤外域の分光透過率を高く設計した長作動距離、高解像対物レンズです。シリコンを透過してウェハの裏面観察をしたりフォトエミッション故障解析用レンズとして使用できます。20X、50Xは弊社の顕微鏡PS-888Lに取付けてYAGレーザー(波長1064nm)と併用することで、レーザーリペアなどにもご使用いただけます。※LCDガラス補正・シリコン補正に対応いたします。ご相談ください。



### 仕様

型式	PE IR Plan 1X	PE IR Plan 2.5X	PE IR Plan 10X	PE IR Plan 20X	PE IR Plan 50X	PE IR Plan 100X
倍率	1X	2.5X	10X	20X	50X	100X
作動距離	12mm	28mm	30.4mm	12mm	10mm	9.5mm
焦点距離(f)	200mm	80mm	20mm	10mm	4mm	2mm
N.A.	0.03	0.1	0.27	0.5	0.6	0.71
分解能	22.4μm	6.7μm	2.5μm	1.3μm	1.1μm	0.9μm
焦点深度(±D.F)	611μm	55μm	7.5μm	2.2μm	1.5μm	0.9μm
透過率70%以上	800-1600nm	450-1600nm	550-1600nm	800-1600nm	900-1600nm	900-1400nm
ガラス補正	—	—	—	-/1.0mm(LCD)	-/1.0mm(LCD)	—
重量	420g	300g	335g	430g	500g	560g

\* PEIR対物レンズの分解能及び焦点深度は、基本波長(λ=1.1μm)をもとに算出した値です。分解能=0.61xλ/N.A 焦点深度±D (μm)=λ / [2 (N.A.)<sup>2</sup>]